薄膜トランジスタ構造を有するアモルファス酸化物エレクトロクロミック素子

Amorphous oxide electrochromic device with thin film transistor structure ^O小野里尚記¹, 片瀬貴義², 太田裕道²(¹北大院情報科学, ²北大電子研) [°]Takaki Onozato¹, Takayoshi Katase², Hiromichi Ohta² (¹Electronics for Informatics- & ²RIES-Hokkaido Univ.)

E-mail: takaki_onozato6@eis.hokudai.ac.jp

【はじめに】エレクトロクロミック(EC)素子の活性層として用いられる WO₃ は、WO₃ + xA^+ + $xe^ \Leftrightarrow$ A_x WO₃ (A=H, Li)で表される電気化学反応により、無色透明絶縁体⇔青色金属の可逆的な光・電子物性変化を示すことが知られている。この光・電子物性変化を同時に利用することができれば、例えば、遮光と同時に電子機器のスイッチを入れる多機能 EC 素子として応用できるが、現在の EC 素子は二枚の透明電極間に活性層を挟み込んだ平行平板構造であるため、活性層の電子物性変化を利用することはできない。本研究では、静電的な電界効果と電気化学反応を組合わせることが可能な CAN^[1]ゲート薄膜トランジスタ(TFT)構造に着目し、アモルファス(a-)WO₃を活性層として用いた TFT 型 EC 素子の試作とその動作機構を調べた結果、a-WO₃ TFT-EC の動作は Faraday の電気分解の法則に従うことが分かったので報告する。

【作製】 無アルカリガラス基板上に a-WO₃ TFT-EC (トップゲート型, *L/W*=800/400 µm)を作製した。各薄 膜は PLD 法により、基板加熱なし(室温)で成膜した(活性層 a-WO₃ 80 nm, ゲート絶縁体 CAN 300 nm, ゲート電極 NiO 20 nm/ITO 20 nm, ソース&ドレイン電極 ITO 20 nm)。ゲート電極下での酸素ガス発生を 抑制するために NiO 層を用いた。

【結果および考察】 作製した a-WO₃ TFT-EC では、 正のゲート電圧(Vg=3-10 V)を印加することで、静 電的な電界効果により平行平板構造ができ、次い でCAN中のH⁺がa-WO3薄膜中に電気化学的に 拡散することによってゲート電流が流れる。流れた ゲート電流密度の時間変化から電子密度を算出 し、a-WO3のシート抵抗R。に対してプロットしたとこ ろ(図左、プロトン化)、R。は電子密度の二乗に比 例して減少し、電子密度 1.2×10¹⁷ cm⁻²(≈1.5×10²² cm^{-3}) で~40 Ω sq⁻¹ の金属になり飽和した。 次いで、 負のゲート電圧(Vg=3-10 V)を印加したところ(図 右、脱プロトン化)、流れた電子密度が 1.3×10¹⁷ cm⁻²(≈1.6×10²² cm⁻³)を超えると急激に R_sが増大 し、絶縁体 a-WO3 に戻った。無色透明絶縁体⇔ 青色金属の切替えに必要な電子密度 1.5×10²² cm^{-3} は、WO₃ + xH^+ + xe^- ⇔ H_xWO₃ における x=1 と一致することから、作製した a-WO3 TFT-EC の動作は Faraday の電気分解の法則に従うことが 分かった。



Figure Change in sheet resistance R_s of a-WO₃ active layer as a function of electron density under the application of $V_g = 3-10$ V.

文献 [1] H. Ohta *et al.*, *Nature Commun.* **1**, 118 (2010). 謝辞 本研究は JSPS 科研費新学術領域研究「ナノ構造情報」(25106007)、基盤研究(A)(25246023)、 若手研究(A)(15H05543)の助成を受けて実施した。